

出展のご案内

拝啓、貴下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てに預かり厚く御礼申し上げます。さて弊社は来る10月27日(水)～29日(金)に東京ビッグサイト南2ホールで開催されますJPGA 内の「InterOpto」に出展致します。弊社は理科学用・研究開発・産業用の最先端のウルトラファーストレーザ、レーザ計測・制御機器、最新の分光器、光学機器、更に薄膜計測機器をご紹介させて頂き、皆様のお役に立ちたいと存じます。

出展品目

- New** ● 高出力・高エネルギー極短パルスレーザ (PHAROS & CARBIDE)
- New** ● リアルタイム次世代型、高性能オートコリレータ (pulseCheck-NX)
- New** ● 波長ごとのデータが得られる1Mpixelsハイパースペクトルカメラ (HSC-2)
- New** ● LCOS反射型高速・高解像度**SLM液晶空間光変調器** (SLM HSP 1920x1152)
 - プラズマ計測等にも最適な高速4096高解像度CMOS分光器 (AvaSpec-4096CL-EVO)
 - LIBS, LIF等レーザ応用分光に最適なLD励起高効率ナノ秒レーザ (TINYシリーズ)
 - センサ・監視・LIDER等に最適な低コストサーマルイメージングレンズ (高品質IRレンズ)
- 注目** ● **薄膜密着強度試験機** (ROMULUS) ● 光学干涉式膜厚モニター (AvaThinfilm)



見どころ

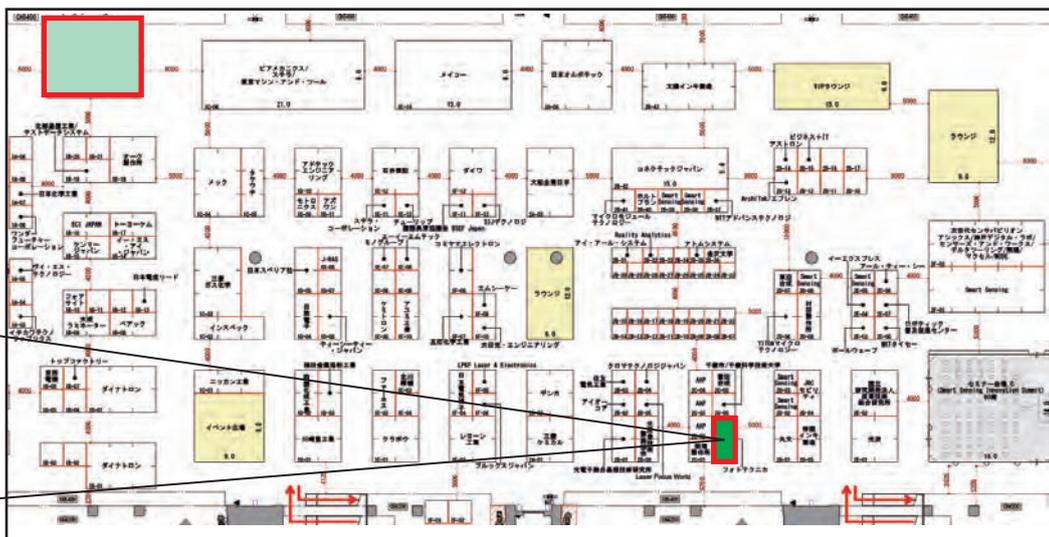
最先端のフェムト秒・ピコ秒・ナノ秒レーザは高品位な微細加工等の産業用、各種の分光等研究開発・理科学用途に最適です。高速・高解像度SLMのプレゼンテーションとデモに乞うご期待。また新製品のオートコリレータ、ハイパースペクトルカメラなどをご紹介します。更に薄膜の引張り試験機のプレゼンテーションとデモは皆様のお役に立ちます。膜厚モニターやLIBS等、分光器の応用計測をご紹介します。皆様のご来場をお待ちしております。

プレゼンテーション会場 →
 フォトテクニカ(株)

① 10/27 (水) 14:15-14:35
 SLM(液晶空間光変調器)と応用

② 10/28 (木) 14:15-14:35
 薄膜密着強度測定方法について

南2ホール
No.2C-07
 フォトテクニカ(株)



★出展社プレゼンテーションには是非ご来場ください。定員が40名となっております。ご登録頂ければ優先的にご入場頂けます。

貴社名:
 お名前:
 e-mail:

部署:
 TEL:

①、②をいれて下記メール (fax) 宛てにご送付して下さい。
 e-mail: voc@phototechnica.co.jp
 Fax: **048-871-0068**